



### Mô tả Sản phẩm:

Hệ thống đánh dấu laser CarmanHaas có thể được áp dụng để đánh dấu tất cả các vật liệu không trong suốt. Hệ thống quang học chung: Mở rộng chùm tia qua tia mở rộng để cải thiện góc phân kỳ, sau khi chùm ánh sáng kết hợp đèn báo vào hệ thống điện kế để làm lệch và quét chùm tia, cuối cùng, phôi được quét và tập trung bởi ống kính quét F-Theta.

Các thành phần quang học đánh dấu laser chủ yếu bao gồm expander chùm tia và ống kính quét f-theta. Vai trò của bộ mở rộng chùm tia là phóng to đường kính chùm tia và giảm góc phân kỳ chùm tia. [\*\*Ống kính quét F-Theta được bán\*\*](#) Carmanhaas đạt được sự tập trung đồng nhất của chùm tia laser.



## ZNSE SCAN LENS

- Dia Tol:  $+0/-0.13\text{mm}$
- Thk Tol:  $\pm 0.25\text{mm}$
- FI Tol:  $< +/- 2\%$
- ETV:  $< 3 \text{ arc min}$
- CA:  $> 90\%$
- Surface Figure:  $L/20 @ 10.6\mu\text{m}$
- AR:  $R < 0.25\% @ 10.6\mu\text{m}$

### Detail Image



### Related Optics:



## Các thông số kỹ thuật:

### Ống kính quét CO2 F-theta (9,2-9.7um)

<b>Part Description</b>	<b>FL(mm)</b>	<b>Scan Field (mm)</b>	<b>Max Entrance Pupil (mm)</b>	<b>Working Distance (mm)</b>	<b>Mounting Thread</b>
SL-10.6-50-75	75	50x50	14	57.5	M85x1
SL-10.6-70-100	100	70x70	14	85.7	M85x1
SL-10.6-90-125	125	90x90	14	111.9	M85x1
SL-10.6-110-150	150	110x110	14	135.9	M85x1
SL-10.6-140-230	230	140x140	14	227	M85x1
SL-10.6-175-250	250	175x175	14	232	M85x1
SL-10.6-210-300	300	210x210	14	288	M85x1
SL-10.6-250-360	360	250x250	14	352.9	M85x1
SL-10.6-300-430	430	300x300	14	414.7	M85x1